

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 3 区分
 【発行日】平成26年7月17日 (2014.7.17)

【公表番号】特表2013-533125(P2013-533125A)
 【公表日】平成25年8月22日 (2013.8.22)
 【年通号数】公開・登録公報2013-045
 【出願番号】特願2013-515384(P2013-515384)
 【国際特許分類】

B 2 4 D 11/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/11 (2012.01)

【 F I 】

B 2 4 D 11/00 B

H 0 1 L 21/304 6 2 2 F

B 2 4 B 37/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成26年5月27日 (2014.5.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 主表面と、第 2 主表面と、第 1 エッジと、第 2 エッジと、チャネルとを有し、前記チャネルが、前記第 1 主表面内に形成され、前記第 1 エッジから前記第 2 エッジへと延在している、支持パッドと、

前記支持パッドの一部に配置可能な第 1 研磨エレメントと、

前記支持パッドの一部に配置可能な第 2 研磨エレメントと、

前記チャネル内に配置され、前記第 1 研磨エレメントのエッジと前記第 2 研磨エレメントのエッジとを前記支持パッドに固定するための固定メカニズムと、を含む、研磨物品。

【請求項 2】

前記固定メカニズムが、感圧接着剤、面ファスナー取り付け、機械的取り付け、又は永久接着剤のうち 1 つを含む、請求項 1 に記載の研磨物品。

【請求項 3】

第 1 主表面及び第 2 主表面を有するパッドと、

前記第 1 主表面の一部に配置可能な第 1 研磨エレメントと、

前記第 1 主表面の一部に配置可能な第 2 研磨エレメントと、

前記第 1 主表面により画定される面の下に位置し、前記第 1 研磨エレメントのエッジと前記第 2 研磨エレメントのエッジとを前記パッドに取り付ける固定メカニズムと、を含む、固定研磨物品。

【請求項 4】

前記固定メカニズムが、感圧接着剤、面ファスナー取り付け、機械的取り付け、又は永久接着剤のうち 1 つを含み、或いは、第 1 スリット及び第 2 スリットを有するブロックと、前記第 1 スリット内に前記第 1 研磨エレメントの前記エッジを保持し、前記第 2 スリット内に前記第 2 研磨エレメントの前記エッジを保持するための手段と、を含む、請求項 3 に記載の固定研磨物品。

【請求項 5】

加工対象製品の表面を研磨する方法であって、

第 1 主表面、第 1 エッジ、第 2 エッジ、及び、前記第 1 主表面内に位置し前記第 1 エッジから前記第 2 エッジへと延在するチャンネルを有する支持パッドを準備する工程と、

前記支持パッドの前記第 1 主表面の一部を第 1 研磨エレメントで覆う工程と、

前記第 1 研磨エレメントのエッジを、前記支持パッドの前記チャンネル内に配置する工程と、

前記支持パッドの前記第 1 主表面の一部を第 2 研磨エレメントで覆う工程と、

前記第 2 研磨エレメントのエッジを、前記支持パッドの前記チャンネル内に配置する工程と、

前記第 1 及び第 2 研磨エレメントの前記エッジを、前記チャンネル内に保持する工程と、

前記第 1 及び第 2 研磨エレメントを、前記加工対象製品の表面に接触させる工程と、

前記加工対象製品と、固定された前記研磨エレメントとを互いに対して動かす工程と、
を含む、方法。